



Environmental Test Solutions

電子散斑干涉儀

Electrical Speckle Pattern Interferometer (ESPI)

Specifications

- 雷射器 (GREEN LASER 或 He-Ne LASER)
- 分光方稜鏡 (U 場)、楔形鏡 (W 場)
- 全反射鏡 (Mirror)
- Zoom 鏡片組
- CCD Camera
- 擴束鏡、雙偏振片
- 各種精密機械調節可達到: 0.3~ 0.6 μ
- 系統軟體



Features

電子散斑干涉系統 -- (ESPI) 電子散斑干涉系統可以對各種元件進行三維和高敏感性的變形和應變分析，這個非接觸測量技術可進行全場量測，且在測量物上不需要任何標記，由於它的高密度系統探頭可對任何材料測試任務上提供更方便和具彈性的安裝。

一維電子散斑干涉系最適合複雜元件和電子結構、汽車設計、機械加工和材料研究的研發和測試，它是理想的實驗驗證技術，能對分析技術以及數值計算技術作有效的驗證。

